



中華民國專利證書

發明第 I 807653 號

發明名稱：高深寬比微結構光學量測系統

專利權人：國立臺灣大學

發明人：陳亮嘉、伍國璋、簡維信

專利權期間：自2023年7月1日至2042年2月22日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

廖承威

中華民國



112

年

7

月

1

日

